МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

# РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
## на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2021 р.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ЗАТВЕРДЖУЮ<br>Проректор з навчальної роботи<br><br>_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО<br>"___ "_____ 2024 р. | Спеціальність<br>Освітня програма<br>Освітній ступінь<br>Випускова кафедра | 153 Мікро- та наносистемна техніка<br>Мікро- та наноелектроніка<br>бакалавра<br>*Кафедра мікроелектроніки* | Факультет/ННІ<br>Форма здобуття вищої освіти<br>Строк навчання<br>Кваліфікація | Факультет електроніки<br>*Очна (денна)*<br>3 роки 10 місяців<br>бакалавр з мікро- та наносистемної техніки |

| № п/п | Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.) | Кафедра | К-ть здобув. Бюджет | К-ть здобув. Контракт | Обсяг дисциплін Кред ECTS | Обсяг дисциплін Години | Аудиторні години Всього | Лекції за НП | Лекції з урах. інд занять | Практ. (комп. прк) за НП | Практ. (комп. прк) з урах. інд занять | Лабор за НП | Лабор з урах. інд занять | Інд. зан. | СРС | Контрольні заходи Екзамени | Залики | МКР | Курсові роботи | Курсові проекти | РГР,РР,ГР | ДКР | Реф. | Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами 4 курс ДП-11 (Б: 13, К: 1); ДП-12 (Б: 16, К: 0); 7 семестр 18 тижнів Всього | 7 семестр у т.ч. Лекц. | 7 семестр у т.ч. Практ | 7 семестр у т.ч. Лаб | 8 семестр 9 тижнів Всього | 8 семестр у т.ч. Лекц. | 8 семестр у т.ч. Практ | 8 семестр у т.ч. Лаб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| | 1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цикл загальної підготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | *Економіка і організація виробництва* | ЕК | 29 | 1 | 4.0 | 120 | 72 | 36 | - | 36 | - | - | - | 0 | 48 | | 7 | 7 | | | | | | 4 | 2 | 2 | | | | | |
| 2 | *Охорона праці та цивільний захист* | ОПЦБ | 29 | 1 | 4.0 | 120 | 72 | 36 | - | 28 | - | 8 | - | 0 | 48 | | 7 | 7 | | | | | | 4 | 2 | 1.56 | 0.44 | | | | |
| 3 | *Іноземна мова професійного спрямування-2* | АМТС1 | 29 | 1 | 3 | 90 | 54 | - | - | 54 | - | - | - | 0 | 36 | 8 | | 7 | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| | Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки | | | | 11 | 330 | 198 | 72 | 0 | 118 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5.56 | 0.44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | Цикл професійної підготовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | *Схемотехніка - 2. Цифрова схемотехніка* | ЕІ | 29 | 1 | 7.5 | 225 | 108 | 54 | - | 18 | - | 36 | - | 0 | 117 | 7 | | 7 | | | | | | 6 | 3 | 1 | 2 | | | | |
| 5 | *Курсовий проект зі схемотехніки* | ЕІ | 29 | 1 | 1.5 | 45 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 45 | | 7 | | | 7 | | | | | | | | | | | |
| 6 | *Переддипломна практика* † | МЕ | 29 | 1 | 6.0 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | *Дипломне проектування* | МЕ | 29 | 1 | 6.0 | 180 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 180 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки | | | | 21 | 630 | 108 | 54 | 0 | 18 | 0 | 36 | 0 | 0 | 522 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ | | | | 32 | 960 | 306 | 126 | 0 | 136 | 0 | 44 | 0 | 0 | 654 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6.56 | 2.44 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| | 2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | *Основи сенсорної електроніки* | МЕ | 22 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | | 7 | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 9 | *Сенсорні матеріали та технології* | МЕ | 11 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | 7 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 10 | *Інформаційні технології проектування у мікро- і наносистемах* ‡ | ЕІ | 14 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | - | - | 18 | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | | 7 | | 3 | 2 | | 1 | | | | |
| 11 | *Мікроконтролери* | МЕ | 20 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | | 7 | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 12 | *Функціональна електроніка* | МЕ | 13 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | 7 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 13 | *Функціональні пристрої для обробки інформації* | МЕ | 7 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 7 | 7 | | | 7 | | | 3 | 2 | 1 | | | | | |
| 14 | *Програмовані логічні інтегральні схеми* | МЕ | 12 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | 6 | 4 | 2 | |
| 15 | *Конструювання електронних приладів і пристроїв* | МЕ | 21 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | | | 8 | | | | | 6 | 4 | 2 | |
| 16 | *Біомедичні сенсори* | МЕ | 17 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | | 8 | | | | | | 6 | 4 | 2 | |
| 17 | *Оптоелектроніка* † | МЕ | 22 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | 8 | | | | | | | 6 | 4 | 2 | |
| 18 | *Наноструктури в оптоелектроніці* ‡ | МЕ | 15 | 1 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | - | - | 18 | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | 8 | | | | | | | 6 | 4 | | 2 |
| 19 | *Електроніка надвисоких частот* | МЕ | 21 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | 18 | - | - | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | 8 | | | | | | | 6 | 4 | 2 | |
| 20 | *Мікрохвильова техніка* ‡ | ЕІ | 8 | 0 | 4.0 | 120 | 54 | 36 | - | - | - | 18 | - | 0 | 66 | | 8 | 8 | | | | 8 | | | | | | 6 | 4 | | 2 |
| | Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки | | | | 28 | 840 | 378 | 252 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| | ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ | | | | 28 | 840 | 378 | 252 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 16 | 8 | 0 |
| | ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: | | | | 60 | 1800 | 684 | 378 | 0 | 262 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1116 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | 13 | 9.56 | 2.44 | 26 | 16 | 10 | 0 |

| Кількість | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кількість екзаменів | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | |
| Кількість заліків | 11 | | 6 | | | | 5 | | | | | |
| МКР | 11 | | | 7 | | | | 4 | | | | |
| Курсових робіт | 0 | | | | | | | | | | | |
| Курсових проектів | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| РГР, РР, ГР | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| ДКР | 3 | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Рефератів | 1 | | | | | | | | | | | 1 |

† Опанування освітнього компонента здійснюється на підприємстві
‡ Виконано перерозподіл аудиторних годин

Військова підготовка у 5 - 8 семестрах за окремим планом військової підготовки

ПРАКТИКА

| Назва практики | Термін проведення | Тижні | Семестр |
|---|---|---|---|
| Переддипломна практика | 2025-04-14 - 2025-05-18 | 5 | 8 |

АТЕСТАЦІЯ

| Форма випускної атестації | Термін проведення |
|---|---|
| Захист кваліфікаційної роботи | 2025-06-16 - 2025-06-30 |

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ)

| Вид роботи | Норма в годинах на 1 здобувача | Кафедра | Кількість здобувачів Б | Кількість здобувачів К | Всього годин Б | Всього годин К |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Керівництво | 21 | МЕ | 29 | 1 | 609 | 21 |
| Рецензування | 2 | ЕІ | 29 | 1 | 58 | 2 |
| ЕК | 2 | МЕ | 29 | 1 | 58 | 2 |
| Всього годин | 25 | Всього годин | | | 725 | 25 |

Ухвалено на засіданні Вченої ради ФЕЛ ПРОТОКОЛ № 04/2024 від 2024-04-22

Завідувач кафедри МЕ _____ Дмитро ТАТАРЧУК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Валерій ЖУЙКОВ
(підпис)

*Примітка*: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;